

**研究タイトル:**

# 酸化物半導体によるデバイス作製



氏名:	柏葉 安宏／KASHIWABA Yasuhiro	E-mail:	kashi@sendai-nct.ac.jp
職名:	教授	学位:	博士(工学)
所属学会・協会:	応用物理学会, 電気学会		

研究分野:	電気電子工学
キーワード:	薄膜, 結晶, センサ
技術相談	・X線回折による結晶性評価(薄膜, パルク結晶) ・薄膜作製
提供可能技術:	・電気的特性(比抵抗, Hall効果)測定

**研究内容:**

紫外線発光素子, 紫外線センサ, 水素ガスセンサ, X線センサ等の電子デバイスの開発を最終目標として, 酸化亜鉛(ZnO)および酸化タンゲステン(WO<sub>3</sub>)等の酸化物半導体に関する研究をおこなっている。

主となる研究テーマは下記である。

1. 有機金属化学気相成長法による ZnO 薄膜の作製
2. RF スパッタリング法による ZnO 薄膜の作製
3. RF スパッタリング法による WO<sub>3</sub>厚膜の作製

その中で、下記の項目を中心に材料の評価をおこないながら、電子デバイスの開発を目指している。

- ①X線回折法による結晶性評価
- ②電気的特性評価
- ③光導電特性評価
- ④フォトリミネッセンス特性評価

現在までに、下記の成果を報告している。

- [1] T. Abe, Y. Suzuki, A. Nakagawa, T. Chiba, M. Nakagawa, Y. Kashiwaba et al., "Application of a ZnO UV sensor for a scintillation-type radiation detector", J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30 (18), 16873 (2019).
- [2] Y. Kashiwaba et al., "Preparation of a Non-Polar ZnO Film on a Single-Crystal NdGaO<sub>3</sub> Substrate by the RF Sputtering Method", J. Electron. Mater. 47, 4345 (2018).
- [3] T. Abe, Y. Nameshida, Y. Ogata, A. Miura, A. Nakagawa, T. Chiba, Y. Kashiwaba, et al., "Improvement of the Photoconductive Characteristics of ZnO Single Crystals by Annealing", J. Electron. Mater. 47, 4345 (2018).
- [4] T. Abe, S. Takahashi, S. Kamada, A. Nakagawa, T. Chiba, M. Nakagawa, S. Chiba, Y. Kashiwaba, et al., "Photoconductive properties of undoped and nitrogen-doped ZnO single crystals in various ambiances", Physica Status Solidi C 13, NO 7-9, 581 (2016).
- [5] T. Abe, A. Nakagawa, M. Nakagawa, T. Chiba, S. Takahashi, Y. Kashiwaba et al., "Optical characterization by variable angle spectroscopic ellipsometry of nitrogen-doped Mg<sub>x</sub>Zn<sub>1-x</sub>O thin films prepared by the plasma-assisted reactive evaporation method", Thin Solid Films 571, 615 (2014).

**提供可能な設備・機器:**
**名称・型番(メーカー)**

X線回折測定装置 D8 Discover	
比抵抗/ホール効果測定システム ResiTest 8400ACLR 型	